

<p>粒子計測装置および方法</p>	
<p>概要・品質・性能</p> <p>粒子系及び三次元位置の計測パラメーターを校正するための作業軽減手段。レーザービームをビームスプリッターに照射して3つの分岐ビームを得る。</p> <p>第1のビームを計測対象領域に照射して当たった粒子の0次反射光と1次屈折光の光強度が同等となる散乱角<math>\theta</math>で計測領域を撮影する第1電子カメラを備える。</p> <p>第2出力ビームを第1参照光として第1電子カメラに投射する。</p> <p>第3ビームを第2参照光として、第1電子カメラの光軸に対してステレオ角<math>\phi</math>で投射される第2電子カメラを備える。2台のカメラにより粒子計測の校正を軽減し、高精度の三次元位置計測を容易にする。</p>	<p>             L1: 散乱測定ビーム              L1a: ショット散乱ビーム              L2: 第1参照ビーム              L3: 第2参照ビーム  <math>\theta</math>: Scattering angle  <math>\phi</math>: Stereoview angle         </p>
<p>用途</p> <p>粒子系及び三次元位置計測が可能であり、かつパラメーター校正のための作業軽減</p>	<p>技術移転</p> <p>①形態 特許売却 特許実施権供与              ②相手先 問わない              ③地域 国内に限る</p>
<p>実用化・情報</p> <p>[試作・実験] 完了              [製造・販売実績] 無し              [技術情報の提供] 技術資料、特許公報              [情報提供者] 埼玉大学 研究機構              オープンイノベーションセンター              [連絡先] 知的財産部門 整理番号：0603-50              TEL 048-858-9106 FAX 048-858-9120              e-mail coic-chizai@ml.saitama-u.ac.jp</p>	<p>特許等</p> <p>特許番号 特許第4774517号              登録日 平成23年7月8日              特許権者 国立大学法人埼玉大学              発明者 川橋正昭・平原裕行</p>